



認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS の校正事業者として認定する。

認 定 識 別：JCSS 0029 Calibration

適合性評価機関の名称：一般財団法人日本品質保証機構
計量計測センター

法 人 の 名 称：一般財団法人日本品質保証機構

適合性評価機関の所在地：東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4

認 定 範 囲：長さ、質量、温度、角度、流量・流速、
振動加速度、電気（高周波）及び電磁界、
力、音響・超音波、放射線・放射能・中性子、
硬さ、湿度
（詳細は別紙のとおり）

認 定 の 基 準：ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書(JCSS 認定) (第 2 版)
6 項に定める認定要求事項

認 定 発 効 日：2020 年 3 月 30 日

認定の有効期限：2024 年 3 月 29 日

(初回認定発効日：1996 年 4 月 3 日)

独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター所長 山本 健一



・IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認取決め) に署名している認定機関です。

・相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。

・この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。

・本認定証は、発行日時点の認定情報であり、最新の認定情報は IAJapan のホームページで確認することができます。

登録（認定）に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録年月日：1994 年 5 月 2 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：1994 年 5 月 2 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：波長計量器、一次元寸法測定器、形状測定器[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
波長計量器	633 nm 領域の波長		4.2×10^{-11}
一次元寸法測定器	ブロックゲージ (光波干渉測定法による)	0.1 mm 以上 100 mm 以下	0.02 μm
		100 mm 超 250 mm 以下	$(0.01+L/3500) \mu\text{m}$
		250 mm 超 400 mm 以下	$(0.02+L/3400) \mu\text{m}$
		400 mm 超 800 mm 以下	$(0.02+L/3200) \mu\text{m}$
		800 mm 超 1000 mm 以下	$(0.02+L/3100) \mu\text{m}$
	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.1 mm 以上 100 mm 以下	0.07 μm
		100 mm 超 500 mm 以下	$(0.005+L/1800) \mu\text{m}$
		500 mm 超 1000 mm 以下	$(0.025+L/1800) \mu\text{m}$
	各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定法による)	0.1 mm 以上 1010 mm 以下	$(0.2+L/650) \mu\text{m}$
	標準尺	300 mm 以下	0.4 μm
		300 mm 超 1000 mm 以下	$(0.2+L/1500) \mu\text{m}$
	伸び計校正器	25 mm 以下	0.3 μm
		25 mm 超 50 mm 以下	0.4 μm
		50 mm 超 75 mm 以下	0.5 μm
		75 mm 超 100 mm 以下	0.6 μm
	伸び計	5 mm 以下	0.8 μm
		5 mm 超 50 mm 以下	2.4 μm
		50 mm 超 600 mm 以下	6.4 μm
形状測定器	一次元回折格子	97 nm 以上 1000 nm 以下	0.03 nm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一次元寸法測定器	伸び計	5 mm 以下	0.8 μm
		5 mm 超 50 mm 以下	2.4 μm
		50 mm 超 600 mm 以下	6.4 μm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：1996 年 11 月 14 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：1996 年 11 月 14 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：分銅等、はかり[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)		
			等量比較による校正		等量比較以外の 方法による校正
			協定質量 の校正	真の質量値 の校正	協定質量の校正
分銅等	分銅、 おもり	50 kg	0.30 g	12 µg/g	—
		20 kg 超 50 kg 未満	4.0 µg/g	11 µg/g	—
		20 kg	7.0 mg	11 µg/g	6.0 mg
		10 kg 超 20 kg 未満	4.0 µg/g	11 µg/g	—
		10 kg	3.0 mg	4.0 µg/g	2.1 mg
		5 kg 超 10 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		5 kg	1.8 mg	4.0 µg/g	1.1 mg
		3 kg 超 5 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		3 kg	1.5 mg	4.0 µg/g	—
		2 kg 超 3 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		2 kg	0.60 mg	4.0 µg/g	0.42 mg
		1 kg 超 2 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		1 kg	0.20 mg	4.0 µg/g	0.16 mg
		500 g 超 1 kg 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		500 g	0.11 mg	4.0 µg/g	0.085 mg
		300 g 超 500 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		300 g	0.15 mg	4.0 µg/g	—
		200 g 超 300 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		200 g	0.060 mg	4.0 µg/g	0.035 mg
		100 g 超 200 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		100 g	0.030 mg	4.0 µg/g	0.019 mg
		50 g 超 100 g 未満	4.0 µg/g	4.0 µg/g	—
		50 g	0.020 mg	4.1 µg/g	0.010 mg
		30 g 超 50 g 未満	5.0 µg/g	4.7 µg/g	—
		30 g	0.026 mg	5.4 µg/g	—
		20 g 超 30 g 未満	8.0 µg/g	9.0 µg/g	—
		20 g	0.015 mg	8.7 µg/g	0.0080 mg
		10 g 超 20 g 未満	9.0 µg/g	10 µg/g	—
		10 g	0.010 mg	15 µg/g	0.0060 mg
		5 g 超 10 g 未満	15 µg/g	17 µg/g	—
		5 g	0.0080 mg	25 µg/g	0.0050 mg
		3 g 超 5 g 未満	32 µg/g	35 µg/g	—
		3 g	0.013 mg	56 µg/g	—
		2 g 超 3 g 未満	25 µg/g	28 µg/g	—
		2 g	0.0060 mg	60 µg/g	0.0040 mg
		1 g 超 2 g 未満	40 µg/g	60 µg/g	—
		1 g	0.0050 mg	81 µg/g	0.0030 mg
		500 mg 超 1 g 未満	50 µg/g	90 µg/g	—
		500 mg	0.0040 mg	0.15 mg/g	0.0025 mg

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)		
			等量比較による校正		等量比較以外の 方法による校正
			協定質量 の校正	真の質量値 の校正	協定質量の校正
分銅等	分銅、 おもり	200 mg 超 500 mg 未満	80 µg/g	0.15 mg/g	—
		200 mg	0.0030 mg	0.17 mg/g	0.0020 mg
		100 mg 超 200 mg 未満	0.16 mg/g	0.20 mg/g	—
		100 mg	0.0025 mg	0.22 mg/g	0.0015 mg
		50 mg 超 100 mg 未満	0.25 mg/g	0.30 mg/g	—
		50 mg	0.0020 mg	0.30 mg/g	0.0012 mg
		20 mg 超 50 mg 未満	0.45 mg/g	0.45 mg/g	—
		20 mg	0.0016 mg	0.70 mg/g	0.0010 mg
		10 mg 超 20 mg 未満	0.90 mg/g	0.90 mg/g	—
		10 mg	0.0012 mg	1.1 mg/g	0.00080 mg
		5 mg 超 10 mg 未満	1.6 mg/g	1.6 mg/g	—
		5 mg	0.0011 mg	1.8 mg/g	0.00060 mg
		2 mg 超 5 mg 未満	3.2 mg/g	3.2 mg/g	—
		2 mg	0.0011 mg	4.3 mg/g	0.00060 mg
		1 mg 超 2 mg 未満	6.0 mg/g	6.0 mg/g	—
		1 mg	0.0011 mg	9.0 mg/g	0.00060 mg
		0.8 mg	0.0016 mg	—	—
		0.6 mg	0.0014 mg	—	—
		0.5 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg
		0.4 mg	0.0014 mg	—	—
		0.2 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg
		0.1 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg
		0.05 mg	0.00080 mg	—	0.00040 mg

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式 非自動 はかり	150 kg 超 600 kg 以下	16 $\mu\text{g/g}$	16 $\mu\text{g/g}$
		20 kg 超 150 kg 以下	9.6 $\mu\text{g/g}$	9.6 $\mu\text{g/g}$
		20 kg	3.0 $\mu\text{g/g}$	3.0 $\mu\text{g/g}$
		100 g 超 20 kg 未満	1.1 $\mu\text{g/g}$	1.1 $\mu\text{g/g}$
		100 g	0.97 $\mu\text{g/g}$	0.97 $\mu\text{g/g}$
		50 g 超 100 g 未満	1.8 $\mu\text{g/g}$	1.8 $\mu\text{g/g}$
		50 g	1.2 $\mu\text{g/g}$	1.2 $\mu\text{g/g}$
		20 g 超 50 g 未満	2.8 $\mu\text{g/g}$	2.8 $\mu\text{g/g}$
		10 g 超 20 g 以下	2.4 $\mu\text{g/g}$	2.4 $\mu\text{g/g}$
		10 g	3.6 $\mu\text{g/g}$	3.6 $\mu\text{g/g}$
		5 g 超 10 g 未満	8.8 $\mu\text{g/g}$	8.8 $\mu\text{g/g}$
		5 g	5.9 $\mu\text{g/g}$	5.9 $\mu\text{g/g}$
		2 g 超 5 g 未満	14 $\mu\text{g/g}$	14 $\mu\text{g/g}$
		1 g 超 2 g 以下	12 $\mu\text{g/g}$	12 $\mu\text{g/g}$
		1 g	18 $\mu\text{g/g}$	18 $\mu\text{g/g}$
		500 mg 超 1 g 未満	45 $\mu\text{g/g}$	45 $\mu\text{g/g}$
		500 mg	30 $\mu\text{g/g}$	30 $\mu\text{g/g}$
		200 mg 超 500 mg 未満	71 $\mu\text{g/g}$	71 $\mu\text{g/g}$
		100 mg 超 200 mg 以下	59 $\mu\text{g/g}$	59 $\mu\text{g/g}$
		100 mg	94 $\mu\text{g/g}$	94 $\mu\text{g/g}$
		50 mg 超 100 mg 未満	0.22 mg/g	0.22 mg/g
		50 mg	0.15 mg/g	0.15 mg/g
		20 mg 超 50 mg 未満	0.36 mg/g	0.36 mg/g
		10 mg 超 20 mg 以下	0.30 mg/g	0.30 mg/g
		10 mg	0.47 mg/g	0.47 mg/g
		5 mg 超 10 mg 未満	1.4 mg/g	1.4 mg/g
		5 mg	0.71 mg/g	0.71 mg/g
		2 mg 超 5 mg 未満	2.4 mg/g	2.4 mg/g
		2 mg	1.8 mg/g	1.8 mg/g
		1 mg	3.6 mg/g	3.6 mg/g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：温度

法律に基づく初回登録年月日：2014 年 11 月 13 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2014 年 11 月 13 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：接触式温度計[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	ガラス製温度計	0 °C以上 50 °C以下		0.04 °C
		-40 °C以上 100 °C未満		0.03 °C
	指示計器付温度計 (比較校正法)	100 °C		0.04 °C
		100 °C 超 200 °C 以下		0.06 °C
		200 °C 超 300 °C 以下		0.08 °C
		恒温槽 装備	-40 °C 以上 300 °C 以下	0.4 °C

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	指示計器付温度計 (比較校正法)	恒温槽 装備	-40 °C 以上 300 °C 以下	0.4 °C

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：角度

法律に基づく初回登録年月日：2006 年 3 月 1 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2006 年 3 月 1 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：角度測定器[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
角度測定器	ロータリエンコーダ	0° ～ 360°	225,000 点以下	0.04"
	ロータリエンコーダ 校正装置(自己校正装置)	0° ～ 360°		0.03"

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回登録年月日：2001 年 2 月 20 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2001 年 2 月 20 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：気体流速計[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
気体流速計	気体用流速計 (微風速)	0.05 m/s 以上 0.30 m/s 未満	0.017 m/s
		0.30 m/s 以上 0.59 m/s 未満	0.022 m/s
		0.59 m/s 以上 0.88 m/s 未満	0.028 m/s
		0.88 m/s 以上 1.21 m/s 未満	0.035 m/s
		1.21 m/s 以上 1.50 m/s 未満	0.042 m/s
	気体用流速計 (中流速)	1.3 m/s	0.04 m/s
		1.3 m/s 超 3 m/s 以下	0.06 m/s
		3 m/s 超 5 m/s 以下	0.06 m/s
		5 m/s 超 7 m/s 以下	0.08 m/s
		7 m/s 超 10 m/s 以下	0.11 m/s
		10 m/s 超 15 m/s 以下	0.15 m/s
		15 m/s 超 20 m/s 以下	0.19 m/s
		20 m/s 超 25 m/s 以下	0.26 m/s
		25 m/s 超 30 m/s 以下	0.32 m/s
		30 m/s 超 35 m/s 以下	0.38 m/s
		35 m/s 超 40 m/s 以下	0.44 m/s

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：振動加速度

法律に基づく初回登録年月日：2005 年 2 月 21 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2005 年 2 月 21 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：振動加速度測定装置等[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
振動加速度測定装置等	振動加速度計 (電圧感度)	0.5 Hz	2 %
		0.63 Hz	2 %
		0.8 Hz	2 %
		1 Hz	1.1 %
		1.25 Hz	1.1 %
		1.6 Hz	1.1 %
		2 Hz	0.8 %
		2.5 Hz	0.8 %
		3.15 Hz	0.8 %
		4 Hz	0.8 %
		5 Hz	0.7 %
		6.3 Hz	0.7 %
		8 Hz	0.7 %
		10 Hz	0.7 %
		12.5 Hz	0.7 %
		16 Hz	0.7 %
		20 Hz	0.6 %
		25 Hz	0.6 %
		31.5 Hz	0.6 %
		40 Hz	0.6 %
		50 Hz	0.6 %
		63 Hz	0.6 %
		80 Hz	0.6 %
		100 Hz	0.4 %
		125 Hz	0.4 %
		160 Hz	0.4 %
		200 Hz	0.6 %
		250 Hz	0.7 %
		315 Hz	0.6 %
		400 Hz	0.6 %
		500 Hz	0.6 %
		630 Hz	0.6 %
		800 Hz	0.6 %
		1 kHz	0.6 %
		1.25 kHz	0.6 %
		1.6 kHz	0.6 %
		2 kHz	0.9 %
		2.5 kHz	1.3 %
		3.15 kHz	2.0 %
		4 kHz	2.0 %
		5 kHz	2.0 %
		6.3 kHz	3 %
		8 kHz	3 %
		10 kHz	3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
振動加速度測定装置等 (続き)	振動加速度計 (電荷感度)	20 Hz	0.7 %
		25 Hz	0.7 %
		31.5 Hz	0.7 %
		40 Hz	0.7 %
		50 Hz	0.6 %
		63 Hz	0.6 %
		80 Hz	0.6 %
		100 Hz	0.5 %
		125 Hz	0.5 %
		160 Hz	0.5 %
		200 Hz	0.7 %
		250 Hz	0.7 %
		315 Hz	0.7 %
		400 Hz	0.7 %
		500 Hz	0.7 %
		630 Hz	0.7 %
		800 Hz	0.7 %
		1 kHz	0.7 %
		1.25 kHz	0.7 %
		1.6 kHz	0.7 %
		2 kHz	1.0 %
		2.5 kHz	1.3 %
		3.15 kHz	2.1 %
		4 kHz	2.1 %
		5 kHz	2.1 %
		6.3 kHz	3 %
		8 kHz	3 %
		10 kHz	3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：電気（高周波）及び電磁界

法律に基づく初回登録年月日：1995 年 6 月 21 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：1995 年 6 月 21 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：高周波測定器等、レーザパワー測定器等[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波 測定器等	高周波電力 発生装置	50 MHz		0.45 %
		10 MHz 以上 12 GHz 以下	1 mW	1.2 %
			10 pW 以上 10 nW 未満	1.8 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
	高周波電力 測定装置	同軸 7 mm	10 MHz, 30 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 300 MHz, 500 MHz, 700 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	0.51 %
			7 GHz, 8 GHz	0.76 %
			9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz	0.88 %
			13 GHz	0.92 %
			14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz	1.4 %
			1 mW	0.7 %
			10 MHz 以上 200 MHz 以下	0.8 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
			100 mW 超 180 W 以下	2.1 %
			1 mW	0.7 %
			200 MHz 超 400 MHz 以下	0.8 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
			100 mW 超 100 W 以下	2.1 %
			1 mW	0.7 %
			400 MHz 超 500 MHz 以下	0.8 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
			100 mW 超 60 W 以下	2.1 %
			1 mW	0.7 %
			500 MHz 超 1 GHz 以下	0.8 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
			100 mW 超 40 W 以下	2.1 %
			1 mW	0.7 %
			1 GHz 超 2 GHz 以下	0.8 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
			100 mW 超 20 W 以下	2.1 %
			1 mW	0.7 %
			2 GHz 超 6 GHz 以下	0.8 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	1.6 %
			1 mW	1.0 %
			6 GHz 超 12 GHz 以下	1.2 %
			10 nW 以上 50 mW 以下	1.6 %
			12 GHz 超 18 GHz 以下	1.6 %
			1 μW	2.0 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波 測定器等	高周波電力 測定装置	同軸 2.9 mm	10 MHz, 30 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 300 MHz, 500 MHz, 700 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz	1 mW 1.1 %
			13 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz, 19 GHz, 20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz, 25 GHz	1 mW 1.4 %
			26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz, 34 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 37 GHz, 38 GHz, 39 GHz, 40 GHz	1 mW 3.1 %
			10 MHz 以上 12 GHz 以下	1 mW 1.6 %
			12 GHz 超 25 GHz 以下	1 mW 2.3 %
			25 GHz 超 40 GHz 以下	1 mW 4.7 %
	高周波電圧 測定装置	10 MHz 以上 50 MHz 以下		0.2 V 以上 0.9 V 以下 0.50 %
		50 MHz 超 500 MHz 以下		0.2 V 以上 0.9 V 以下 0.80 %
		500 MHz 超 1000 MHz 以下		0.2 V 以上 0.9 V 以下 1.2%
	減衰器 (50 Ω)	10 MHz 以上 1 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.011 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.014 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.020 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.031 dB
		1 GHz 超 12 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.016 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.018 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.028 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.037 dB
		12 GHz 超 18 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.022 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.024 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.039 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.046 dB
		18 GHz 超 40 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.028 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.054 dB
	減衰量測定 器等	10 MHz, 30 MHz, 1 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.007 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.010 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.016 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.024 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

(別紙)

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波 測定器等	減衰量測定 器等	12 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.008 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.011 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.027 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.034 dB
		18 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.013 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.016 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.070 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.058 dB
		20 GHz, 25 GHz, 30 GHz 35 GHz, 40 GHz	0 dB 以上 40 dB 以下	0.020 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.047 dB
		10 MHz 以上 1 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.011 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.014 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.020 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.031 dB
		1 GHz 超 12 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.016 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.018 dB
			60 dB 超 80 dB 以下	0.028 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.037 dB
		12 GHz 超 18 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.022 dB
			40 dB 超 60 dB 以下	0.024 dB
			40 dB 超 80 dB 以下	0.039 dB
			80 dB 超 100 dB 以下	0.046 dB
		18 GHz 以上 40 GHz 以下	0 dB 以上 40 dB 以下	0.028 dB
			40 dB 超 80 dB 以下	0.054 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波 測定器等	高周波 インピーダンス (一開口素子)	N 型 50 Ω Male	反射係数 0.1 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満 振幅 U_m : 0.0015~0.0033 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0031~0.0038 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0036~0.0041 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0040~0.0054 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0049~0.0068 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
			反射係数 0.3 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満 振幅 U_m : 0.0022~0.0037 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0036~0.0046 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0042~0.0047 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0048~0.0060 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0054~0.0074 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
			反射係数 0.5 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満 振幅 U_m : 0.0028~0.0042 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0041~0.0056 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0049~0.0058 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0057~0.0076 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0065~0.0093 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
高周波 測定器等	高周波 インピーダンス (一開口素子)	N 型 50 Ω Male	反射係数 1.0 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0048~0.0075 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0072~0.011 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0084~0.011 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 U_m : 0.011~0.015 (振幅ステップ:0.001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 U_m : 0.013~0.020 (振幅ステップ:0.001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
		N 型 50 Ω Female	反射係数 0.1 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0014~0.0033 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0031~0.0039 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0036~0.0045 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0040~0.0051 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0045~0.0057 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
			反射係数 0.3 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満	振幅 U_m : 0.0021~0.0037 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0035~0.0044 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0043~0.0049 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0045~0.0058 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下	振幅 U_m : 0.0050~0.0068 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波 測定器等	高周波 インピーダンス (一開口素子)	N 型 50 Ω Female	反射係数 0.5 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満 振幅 U_m : 0.0027~0.0042 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0040~0.0054 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0050~0.0060 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0051~0.0070 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0056~0.0084 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
			反射係数 1.0 以下	9 kHz 以上 40 MHz 未満 振幅 U_m : 0.0046~0.0075 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				40 MHz 以上 4 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0069~0.010 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				4 GHz 超 8 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0085~0.011 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				8 GHz 超 14 GHz 以下 振幅 U_m : 0.0084~0.013 (振幅ステップ:0.0001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$
				14 GHz 超 18 GHz 以下 振幅 U_m : 0.011~0.017 (振幅ステップ:0.001) 位相 $[\text{°}]$: $\arcsin(U_m / \text{反射係数})$

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

(別紙)

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
レーザパ ワー測定 器等	レーザビーム 用光パワー測定 器	405 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 5 mW 以下	0.29 %
		488 nm 帯及び 515 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 200 mW 以下	0.29 %
		633 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.29 %
		660 nm 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 7 mW 以下	0.29 %
		0.78 μ m 帯、 0.85 μ m 帯及び 1.3 μ m 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 3 mW 以下	0.29 %
		1.05 μ m 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.29 %
		1.55 μ m 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	0.9 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.36 %
			100 μ W 以上 5 mW 以下	0.29 %
	光ファイバ用 光パワー測定 器	0.85 μ m 帯	10 μ W 以上 50 μ W 未満	1.0 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.5 %
			100 μ W 以上 200 μ W 以下	0.35 %
		1.3 μ m 帯及び 1.52 μ m 以上 1.63 μ m 以下	10 μ W 以上 50 μ W 未満	1.0 %
			50 μ W 以上 100 μ W 未満	0.5 %
			100 μ W 以上 10 mW 以下	0.35 %
		対象とする 測定器の 種類： 光電変換型	1 mW	0.36 %
			100 μ W	0.40 %
			10 μ W	0.40 %
			1 μ W	0.40 %
			100 nW	0.41 %
			10 nW	0.41 %
			1 nW	0.42 %
			100 pW	0.45 %
			10 pW	0.60 %
			1 pW	1.9 %
		1.28 μ m 以上 1.34 μ m 以下	1 mW	0.36 %
			100 μ W	0.40 %
			10 μ W	0.40 %
			1 μ W	0.41 %
			100 nW	0.42 %
			10 nW	0.43 %
			1 nW	0.44 %
			100 pW	0.47 %
			10 pW	0.62 %
			1 pW	1.9 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

(別紙)

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
レーザパ ワー測定 器等	光ファイバ用 光パワー測定 器	対象とする 測定器の 種類： 光電変換型	1550 nm	1 mW	0.36 %
				100 μ W	0.39 %
				10 μ W	0.39 %
				1 μ W	0.39 %
				100 nW	0.39 %
				10 nW	0.40 %
				1 nW	0.40 %
				100 pW	0.45 %
				10 pW	0.50 %
				1 pW	1.5 %
			1.52 μ m 以上 1.63 μ m 以下	1 mW	0.36 %
				100 μ W	0.42 %
				10 μ W	0.42 %
				1 μ W	0.43 %
				100 nW	0.43 %
				10 nW	0.43 %
				1 nW	0.43 %
				100 pW	0.48 %
				10 pW	0.54 %
				1 pW	1.5 %
	光電検出器	光ファイバ パワー応答 直線性 [0 dB (1 mW) を基準とし たデシベル 値]	1310 nm	-10 dB	0.0091 dB
				-20 dB	0.0093 dB
				-30 dB	0.0096 dB
				-40 dB	0.0099 dB
				-50 dB	0.011 dB
				-60 dB	0.011 dB
				-70 dB	0.013 dB
				-80 dB	0.022 dB
				-90 dB	0.078 dB
			1.28 μ m 以上 1.34 μ m 以下	-10 dB	0.0093 dB
				-20 dB	0.0098 dB
				-30 dB	0.011 dB
				-40 dB	0.011 dB
				-50 dB	0.012 dB
				-60 dB	0.013 dB
				-70 dB	0.015 dB
				-80 dB	0.023 dB
				-90 dB	0.079 dB
			1550 nm	-10 dB	0.0056 dB
				-20 dB	0.0057 dB
				-30 dB	0.0058 dB
				-40 dB	0.0059 dB
				-50 dB	0.0061 dB
				-60 dB	0.0070 dB
				-70 dB	0.013 dB
				-80 dB	0.017 dB
				-90 dB	0.062 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
レーザパ ワー測定 器等	光電検出器	光ファイバ パワー応答 直線性 [0 dB (1 mW) を基準とし たデシベル 値]	1.52 μ m 以上 1.63 μ m 以下	-10 dB	0.011 dB
				-20 dB	0.011 dB
				-30 dB	0.011 dB
				-40 dB	0.011 dB
				-50 dB	0.011 dB
				-60 dB	0.011 dB
				-70 dB	0.015 dB
				-80 dB	0.018 dB
				-90 dB	0.063 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：力

法律に基づく初回登録年月日：2010 年 9 月 3 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2010 年 9 月 3 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：一軸試験機[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一軸試験機	JIS B 7721 に よる方法	圧縮力	0.1 N 以上 125 kN 以下	0.10 %
			125 kN 超 5 MN 以下	0.20 %
		引張力	0.1 N 以上 125 kN 以下	0.10 %
	ASTM E4 に よる方法	圧縮力	0.1 N 以上 2000 kN 以下	0.40 %
		引張力	0.1 N 以上 100 kN 以下	0.30 %

登録（認定）に係る区分：音響・超音波

法律に基づく初回登録年月日：2005 年 2 月 21 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2005 年 2 月 21 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：音響測定器等[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
音響測定器等	計測用マイクロホン*1 (音圧感度レベル Ⅰ形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 8000 Hz 以下		0.07 dB
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下		0.17 dB
		10000 Hz 超 12500 Hz 以下		0.33 dB
	計測用マイクロホン*1 (音圧感度レベル Ⅱ形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 50 Hz 未満		0.10 dB
		50 Hz 以上 16000 Hz 以下		0.07 dB
		16000 Hz 超 20000 Hz 以下		0.15 dB
	計測用マイクロホン*2 (自由音場感度レベル Ⅰ形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 4000 Hz 以下		0.3 dB
		4000 Hz 超 10000 Hz 以下		0.4 dB
		10000 Hz 超 12500 Hz 以下		0.6 dB
	計測用マイクロホン*2 (自由音場感度レベル Ⅱ形標準マイクロホン)	20 Hz 以上 4000 Hz 以下		0.3 dB
		4000 Hz 超 9000 Hz 以下		0.4 dB
		9000 Hz 超 16000 Hz 以下		0.5 dB
		16000 Hz 超 20000 Hz 以下		0.9 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレ ベル Ⅰ形マイクロホン)	20 Hz 以上 50 Hz 以下		0.4 dB
		50 Hz 超 3150 Hz 以下		0.3 dB
		3150 Hz 超 8000 Hz 以下		0.5 dB
		8000 Hz 超 12500 Hz 以下		0.6 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレ ベル Ⅱ形マイクロホン)	20 Hz 以上 50 Hz 以下		0.4 dB
		50 Hz 超 3150 Hz 以下		0.3 dB
		3150 Hz 超 12500 Hz 以下		0.5 dB
		12500 Hz 超 20000 Hz 以下		0.8 dB
	音響校正器(音圧レベル Ⅰ形標準マイクロホン)	250 Hz		0.08 dB
		1000 Hz		0.08 dB
	音響校正器(音圧レベル Ⅱ形標準マイクロホン)	31.5 Hz		0.11 dB
		63 Hz		0.09 dB
		125 Hz		0.09 dB
		250 Hz		0.09 dB
		500 Hz		0.09 dB
1000 Hz		0.09 dB		
2000 Hz		0.09 dB		
4000 Hz		0.09 dB		
8000 Hz		0.09 dB		
12500 Hz		0.09 dB		
16000 Hz		0.13 dB		
オーディオメータ(Ⅰ形)	音圧レベル (イヤホン の出力)	125 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.6 dB	
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.6 dB	
オーディオメータ(Ⅱ形)	音圧レベル (イヤホン の出力)	125 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.7 dB	
		4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.9 dB	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

*1 カプラを使用した音圧相互校正

*2 自由音場比較校正

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
音響測定器等	音響校正器(音圧レベル I 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.13 dB
		1000 Hz	0.13 dB
	音響校正器(音圧レベル II 形標準マイクロホン)	250 Hz	0.12 dB
		1000 Hz	0.12 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：放射線・放射能・中性子

法律に基づく初回登録年月日：1998 年 11 月 16 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：1998 年 11 月 16 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：X線測定器、γ線測定器[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
X線測定器	線量測定器 (軟X線)	エネルギー範囲：10 keV (1.6 fJ) 以上 30 keV (4.8 fJ) 以下	
		照射線量	100 nC/kg 以上 30 mC/kg 以下 3.3 %
		照射線量率	2.5 μC/(kg・h) 以上 6 μC/(kg・h) 未満 3.5 %
			6 μC/(kg・h) 以上 100 mC/(kg・h) 以下 3.3 %
		空気 吸収線量	3.5 μGy 以上 1.0 Gy 以下 3.3 %
		空気 吸収線量率	90 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 3.5 %
			210 μGy/h 以上 3.5 Gy/h 以下 3.3 %
		空気カーマ	3.5 μGy 以上 1.0 Gy 以下 3.3 %
		空気 カーマ率	90 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 3.5 %
			210 μGy/h 以上 3.5 Gy/h 以下 3.3 %
		線量当量	1 μSv 以上 100 mSv 以下 5.2 %
		線量当量率	25 μSv/h 以上 500 mSv/h 以下 5.5 %
	線量測定器 (中硬X線)	エネルギー範囲：30 keV (4.8 fJ) 以上 200 keV (32 fJ) 以下	
		照射線量	100 nC/kg 以上 60 mC/kg 以下 3.3 %
		照射線量率	100 nC/(kg・h) 以上 6 μC/(kg・h) 未満 3.7 %
			6 μC/(kg・h) 以上 160 mC/(kg・h) 以下 3.3 %
		空気 吸収線量	3.5 μGy 以上 1.8 Gy 以下 3.3 %
		空気 吸収線量率	3.5 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 3.7 %
			210 μGy/h 以上 5.2 Gy/h 以下 3.3 %
		空気カーマ	3.5 μGy 以上 1.8 Gy 以下 3.3 %
		空気 カーマ率	3.5 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 3.7 %
			210 μGy/h 以上 5.2 Gy/h 以下 3.3 %
		線量当量	3 μSv 以上 200 mSv 以下 5.2 %
		線量当量率	3 μSv/h 以上 1 Sv/h 以下 5.5 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
γ線測定器	線量測定器 (¹³⁷ Cs)	照射線量	250 nC/kg 以上 880 nC/kg 未満	3.8 %
			880 nC/kg 以上 250 μC/kg 以下	3.6 %
		照射線量率	250 (nC/kg)/h 以上 800 (nC/kg)/h 未満	4.0 %
			800 (nC/kg)/h 以上 16 (μC/kg)/h 未満	3.7 %
			16 (μC/kg)/h 以上 800 (μC/kg)/h 以下	3.4 %
		空気 吸収線量	8 μGy 以上 28 μGy 未満	3.8 %
			28 μGy 以上 8 mGy 以下	3.6 %
		空気 吸収線量率	8 μGy/h 以上 25 μGy/h 未満	4.0 %
			25 μGy/h 以上 500 μGy/h 未満	3.7 %
			500 μGy/h 以上 25 mGy/h 以下	3.4 %
		空気カーマ	8 μGy 以上 28 μGy 未満	3.8 %
			28 μGy 以上 8 mGy 以下	3.6 %
		空気カーマ率	8 μGy/h 以上 25 μGy/h 未満	4.0 %
			25 μGy/h 以上 500 μGy/h 未満	3.7 %
			500 μGy/h 以上 25 mGy/h 以下	3.4 %
		線量当量	10 μSv 以上 35 μSv 未満	5.6 %
			35 μSv 以上 10 mSv 以下	5.4 %
		線量当量率	10 μSv/h 以上 30 μSv/h 未満	5.6 %
			30 μSv/h 以上 600 μSv/h 未満	5.4 %
			600 μSv/h 以上 30 mSv/h 以下	5.3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：硬さ

法律に基づく初回登録年月日：2006年3月1日

国際MRA対応初回認定発効日：2006年3月1日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：ロックウェル硬さ試験機等、ビッカース硬さ試験機等
[2020年3月30日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
					恒久的施設	現地校正
ロックウェル硬さ 試験機等	ロックウェル硬さ 試験機	20 HRC 以上 25 HRC 以下			0.55 HRC	0.55 HRC
		25 HRC 超 35 HRC 以下			0.55 HRC	0.55 HRC
		35 HRC 超 45 HRC 以下			0.55 HRC	0.55 HRC
		45 HRC 超 55 HRC 以下			0.50 HRC	0.50 HRC
		55 HRC 超 65 HRC 以下			0.40 HRC	0.40 HRC
ビッカース硬さ 試験機等	ビッカース硬さ 試験機	200 HV *	試験力	0.9807 N	16 %	16 %
				4.903 N	7.0 %	7.0 %
				9.807 N	5.1 %	5.1 %
				49.03 N	2.7 %	2.7 %
				98.07 N	2.6 %	2.6 %
		400 HV *	試験力	0.9807 N	22 %	22 %
				4.903 N	10 %	10 %
				9.807 N	7.0 %	7.0 %
				98.07 N	2.6 %	2.6 %
				294.2 N	2.5 %	2.5 %
		700 HV *	試験力	0.9807 N	30 %	30 %
				4.903 N	15 %	15 %
				9.807 N	9.1 %	9.1 %
				98.07 N	5.0 %	5.0 %
				294.2 N	2.7 %	2.7 %
		100 HV 以上 800 HV 以下 ただし、*を除く。 (試験力 0.9807 N 以上 294.2 N 以下)			くぼみ対角線 長さ a) $d \leq 220 \mu\text{m}$ 576/ d % b) $d > 220 \mu\text{m}$ 994/ d % ただし、式中の d は μm	くぼみ対角線 長さ a) $d \leq 220 \mu\text{m}$ 576/ d % b) $d > 220 \mu\text{m}$ 994/ d % ただし、式中の d は μm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：湿度

法律に基づく初回登録年月日：2006 年 3 月 1 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2006 年 3 月 1 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定発効）年月日]：湿度測定器等[2020 年 3 月 30 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
				恒久的施設	現地校正
湿度測定器等	露点計	露点 -20 °C 以上 -10 °C 未満		0.17 °C	—
		露点 -10 °C 以上 50 °C 以下		0.10 °C	—
		露点 50 °C 超 85 °C 以下		0.11 °C	—
		校正温度 5 °C以上 60 °C以下	相対湿度 5 % 以上 40 % 以下	0.5 %	—
			相対湿度 40 % 超 70 % 以下	0.7 %	—
			相対湿度 70 % 超 98 % 以下	1.0 %	—
	通風乾湿計	校正温度 5 °C以上 25 °C以下 但し、露点-10 °C以上 50 °C以下相当の相対 湿度	相対湿度 10 % 以上 98 % 以下	1.0 %	—
	電子式湿度計	校正温度 5 °C以上 60 °C以下 但し、露点-20 °C以上 50 °C以下相当の相対 湿度	相対湿度 5 % 以上 40 % 以下	0.5 %	—
			相対湿度 40 % 超 70 % 以下	0.7 %	—
			相対湿度 70 % 超 98 % 以下	1.0 %	—
		校正温度 50 °C以上 95 °C以下 但し、露点 15 °C以上 85 °C以下相当の相対 湿度	相対湿度 5 % 以上 98 % 以下	3.0 %	—
			露点 -20 °C 以上 50 °C 以下	0.30 °C	—
	熱伝導率式 湿度計	絶対湿度 2.4 g/m ³ 以上 82.8 g/m ³ 以下 ただし、露点 -10 °C 以上 50 °C 以下 相当の絶対湿度		2.2 g/m ³	—
	湿度発生装置	露点 -20 °C 以上 50 °C 以下		0.10 °C	0.20 °C
		校正温度 5 °C以上 60 °C以下 但し、露点-10 °C以上 50 °C以下相当の相対 湿度	相対湿度 5 % 以上 95 % 以下	0.4 %	1.2 %
			相対湿度 95 % 超 98 % 以下	0.4 %	1.4 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。